# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-186702

(43)Date of publication of application: 14.08.1991

(51)Int.Cl.

G01B 7/30 G01C 19/02

(21)Application number: 01-327832

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

18.12.1989

(72)Inventor: SHIOMI YASUHIKO

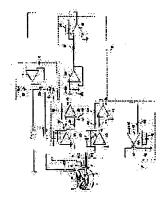
NAKAZAWA ISAO

#### (54) ANGULAR DISPLACEMENT DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute the measurement with high accuracy extending over a wide temperature range by determining in advance a reference value for viscosity with regard to a rotational resistance caused by viscosity of a liquid against a floating body and compensating a portion brought to increase/decrease variation by a temperature variation therefrom by a magnetic force action.

CONSTITUTION: Photocurrents Ia, Ib generated by a light receiving element 9 are separated in accordance with the centroid position of infrared rays which are made incident on the element 9, and converted to voltages Va, Vb by a current – voltage converting circuit. Subsequently, outputs of Va and Vb and inputted to a differential amplifier and come to the output of Va–Vb, and on the other hand, they are inputted to an addition amplifier, as well and come to the output of Va+Vb. This output of Va+Vb is connected to the inversion input terminal of an OP amplifier 45 through a resistance 46, therefore, an iRED driver circuit varies an energizing current to a light emitting element 8 in accordance with the output of Va+Vb. As a result, the control of a negative feedback is executed so that the output of Va+Vb is made equal to a reference voltage KVC connected to the non-inversion input terminal of the amplifier 45. Accordingly, the difference signal Va–Vb of



two outputs of the element 9 can always detect correctly a relative position of an outer cylinder 2 and a floating body 3.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

## ⑱ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−186702

Solnt. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月14日

G 01 B 7/30 G 01 C 19/02 101 2

8505-2F 7414-2F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全12頁)

⑤発明の名称 角変位検出装置

②特 願 平1-327832

功

②出 願 平1(1989)12月18日

@発明者 塩見 泰 ]

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社

玉川事業所内

@発明者 中沢

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社

玉川事業所内

勿出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑩代 理 人 弁理士 本多 小平 外4名

明神。

#### 1.発明の名称

角变位検出装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. 被体体は を対した をがした をがした をでした をでいた をで 出装置。

- 2. 請求項1 において、磁力制御手段は、浮体と塞との相対的な回転角度ズレが生じた時に磁力を発生するものであることを特徴とする 毎変位検出基礎、
- 3. 錦求項2 において、磁力制御手段は、浮体に対する液体の粘性による回転抵抗が予め定めた粘性の基準値から温度変化で増減変化した時に、その変化分を磁力作用で補償するものであることを特徴とする角変位検出装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は慣性力を利用して絶対空間に対する 角変位を検出する装置、例えばカメラの手ブレ 検出等に好適に用いられる角変位検出装置に関 するものである。

#### [従来の技術]

従来この種の角変位検出装置は、例えば特顧 昭63~128375号にて提案されているように、基

## 特開平 3-186702 (2)

本的には以下に群闘する構成をなすものであ り、これを第10図~第12図を用いて栽明す ると、これらの図において、101 は装置を構成 する各部品を取付ける基台、102 は内部に浮体 103および液体 104を封入した室をもつ液体封 入容器としての外間であり、第12図で詳細に 図示されているコ字形の禅体保持体 114が嵌合 して固定されるための清部102aがその内側に形 成されている。103 は磁気特性を有する浮体で あり、軸103a回りに回転自在に上記抒体保持体 114により保持されていて、その中央ブロック の一対の側面の両表面にはミラー 10%とこれを 覆ってスリット110aを有するマクス 110が取付 けられ、똻中央ブロックのもう一対の側面から はそれぞれ腕郎 103b,103bが延出されている。 またこの評体 103は軸103a回りの回転パランス および液体内での浮力パランスがそれぞれとら れたものとして構成される。

104 は外筒 102に封入された液体である。 105 は通電により光を発生する発光素子

勢の位置)で定着させるための磁界作用を及ぼすように一対に設けられ、これらの一端 119a. 120a は図示の如く外倒 102の直径方向に離間対向して設けられている。またこれらのヨーク 121が設けられていると共に、該ョーク 121には電磁コイル122が外装嵌合して組付けられている。これらの構成によりヨーク 118.120.121および浮体103からなる磁気回路が構成され、電磁コイル122の作り出す磁力により浮体 103に磁気的な力を与える。

向上記した浮体 103の回転自在の保持は次のようにして行なわれている。すなわち浮体 103の中央プロックには第11図の断面図 けんでいる上下に貫通の回転軸 111が設けられ、との上下に貫通の回転軸 111が設けられている。一方面記した浮体に対す 112が圧入されている。一方面記した浮体保持 114のコ字形の上下腕の先端に対対に対対してピポット軸受け 113が設けられ、上記ピポット 112の尖鏡な先端がこのピ

(IRED) であり、発光素子保持体 107により上 記載台1に、取付け固定されている。 106は登 ける光の位置によって出力の変化する光電変換 衆子からなる受光素子(PSD)であり、光電変換 素子保持体 108により上記基台 101に取付け固 定されている。そしてこれら発光素子 105およ び受光素子 108が、上記浮体 103の中央ブロッ ク表面に取付けられているミラー 109を介して 光を伝送する方式の光字的な角変位検出の手段 を構成している。なお発光素子保持体 107には 発光素子 105からの光を導く光導部107aが形成 されており、この光導部107mの先端には、上記 浮体 103のミラー 108を覆うマスク 110と同じ スリット110aを有するマスク 110が取付けられ ている。なおこの光伝送は外筒 182を通して行 なわれるものであるから、放外筒 102の全体あ るいは該当する部分は透明体として設けられて いる。

119.120 は、一対のヨークであり、上記磁気 特性を有する浮体 103を一定位置(図示する姿

ポット軸受け 113に嵌合することで浮体の保持がされる。

115 は外筒の上蓋であり、シリコン接着剤等を用いる公知の技術により外筒 2 にシール接着されている。116 はゴムバッキンであり押え板i17と上蓋 116の間にサンドイッチされビス等により固定されている。

以上の構成において、浮体 103はいずれの姿勢においても重力の影響による回転モーメントが発生することなく、またピポット軸に実質的に負荷が作用しないように、上述の如く軸163a回りの回転パランスおよび液体内での浮力パランスがそれぞれとられたものとして構成される。

かかる構成においては、外質が回転軸1034回りに回転しても液体内部は慢性により動かないので、浮遊状態にある浮体 103は回転せず、したがって外筒 102と浮体 103は回転軸1034回りに相対的に回転することになる。これが相対角変位を検出する本装匠の原理であり、これらの

相対的な角変位は、上記発光素子 105、受光素子 108を用いた光学的検知手段で検出できる。

なお実際には外筒 102の壁面の影響で封入された液体内部に流れが生じこれが浮体 103に力を及ぼし粘性力として作用するが、その影響は、壁面から浮体 103までの距離、液体の粘性等を考慮して選択することにより可及的に小さくすることが可能である。

以上の構成を有する装置における角変位の検出は次のように行なわれる。

まず発光素子 105から発せられた光は、光導郎 107aを通り浮体 103に照射され、ここでミラー 109により反射されて受光素子 106に至る。そして上述しているように、光導郎 107a の先端部および浮体 103のミラー 109の上にはマスク 110.110が配置されているため、上記光の伝送の際に光はこれらマスク 110.110のスリット 110a.110aにより略平行光となり、受光素子 106の上にはボケのない像が形成されること

に示した定常状態の位置に定置させる力を与え パネカとして作用させることができる。

この磁界作用により浮体に及ぼされるパネカは、原理的には浮体 103を外筒 102に対して一定の姿勢に維持させる(つまり一体に移動させる)力であるから、そのパネカが強いと外筒 102と浮体 103は一体となって運動してしまい目的とする角変位のための相対角変位が生じないという問題を招くが、磁界作用が被体の関性に対し十分小さければ、比較的低い周波数の角変位にも応答できるように構成できる。

#### [発明が解決しようとする課題]

ところで、前述の説明からわかるように、本装置の性能や大きさは対入する液体によって大きく影響を受けるものである。その為、液体にほせられる制約はきびしく、具体的には光透過性、低粘性、高比重な液体を用いることが求められる。

例えば光透過性は投・受光を用いた光での位 置検出を行なうために不可欠である。また液体 になる.

そして外間 102、発光素子 105、受光素子 106はいずれも基白 101の上に固定されているものであって一体に運動するので、外間 102と 存体 103の間で相対的な角変位運動が生すると、該変位に応じた量だけ受光素子 106の上のスリット像は移動することになる。したがって受光した光の位置によって出力の変化する光電変換素子である該受光素子 106の出力は該スリット像の位置変位に比例した出力となり、該出力を情報として外間 102の角変位を検出することができる。

以上の構成で形成された角変位検出装置を考えると、浮体 103は外部からの力を受けていない状態であるために、浮体 103の姿勢を規制することができないから、そのままでは受光素子106の制定範囲内にスリット像が位置するという保証がないことになるが、例えば上述した電磁コイル 122を用いて浮体に弱い磁界作用を及ばし、この磁界作用により浮体 103を第 1 0 図

以上は、上述した装置に用いられる液体に求められる主な物性であり、実際にこの様な制約に適合する比较的良好な物性をもった液体として、例えばフッ素系の不活性液体等があげられる。しかしながら、上記の主な物性を演足する

## 特局平 3-186702(4)

本発明は以上のような従来技術の問題点を解消し、広い温度範囲に獲って安定、かつ高精度な測定を実現できる角変位検出装置を提供することを目的とする。

また本発明の別の目的は、液体を液体に封入して用いる型の角変位検出装置において、用いる液体の選択の自由を拡大できるようにするところにある。

#### 

以下本発明を図面に示す実施例に基づいて製明する。

[課題を解決するための手段及び作用]

上記目的を実現する本発明の角変位装置の特 徴は、液体を封入した室と、この室内において 一定の軸回りに回転自在に支持され、かつ液体 と実質的に同比重の永久磁石からなる浮体と、 上記室外の一定位置に固定配置されて鉄桿体と の間で磁気吸引力が作用する磁性体と、上記一 定位置から回転変位した浮体の室との相対的な 回転角度ズレを輸出する光学的検出手段と、上 記得体を回転させる磁力を正逆方向に選択的に 付与できるように設けられた磁力発生手段と、 上記液体の温度を検出した情報を出力する偽度 検出手段と、この温度検出手段の出力に基づき 該液体の温度に依存した粘性の増減に応じて上 記磁力発生手段による磁力発生及び磁力強さを 変化させる磁力制御手段を設けたという構成を なすところにある。

上記構成において、磁力制御手段は、浮体と 室との相対的な回転角度ズレが生じた時に磁力 を発生するように制御され、また特に浮体に対

狙されている。なおこの存体3は、軸3b回りの回転パランスおよび存体パランスがそれぞれとられたものとして構成されている。

前途した、浮体3は液体4と同比重の永久磁石材料にて構成されるが、これは例えば次の様にして製作することができる。

5 は上述した浮体保持体であって、後述のビボット軸受13を介して浮体3を保持した状態で外筒2 に固定されている。6 は地板1 に図示の如く取付けられたコの字形状のヨークで、浮体3とともに関磁路を形成する。

# 特爾平 3-186702(5)

7 は色線コイルであり、浮体3 とヨーク6の間の位便に配置されて外筒 2 に対し固定されている。 8 は通電により光を発生する発光素子 (IRED) であり地板1 に取付けられている。 9 は受光する光の位置によって出力の変化するの 4 未子 (PSD)であり、地板1 に取付けられている。 そして、これら発光素子 8 および受光素子 9 が、上記浮体3 の反射面3 a を介して光を伝送する方式の光学的な角変位検出の手段を構成している。

なお、1.0 は発光素子Bの前面に配置されたマスクであり、光を透過するスリット穴 1.0 aを有している。また 1.1 は外筒 2 に取付けられたストッパー部材であり、定められた範囲外に浮体 3 が回転しないように回転限界位置を定めるためにおけられている。

尚上記した浮体3の回転自在の保持は次のようにして行なわれている。すなわち浮体3の中心には第1個A-A の断面図である第2図で示すように上下に先端が尖鏡なピポット12が圧入

以上の構成による作用を説明すると、いま外 第2が回転軸3a回りに回転したとすると の液体4は慣性により絶対空間に対けして でいるので、浮遊状態にある浮体3は回転しない。 したがって外荷2と浮体3は回転も3a回 りに相対的に回転することになる。これまつの相 対的な角変位は、上記発光常出される。

すなわち、発光素子 B から発せられた光は、マスク10のスリット穴10 a を通過し評体3に照射され、ここで突起3 a のスリット状反射面により反射されて受光素子 9 に至る。なお上記光の伝送の際には光はスリット穴10 a とスリット状反射面とにより略平行光となり、受光素子 9 の上にはボケのない像が形成される。

そして外間 2、 発光 素子 8、 受光 素子 9 はいずれ 6 地板 1 に固定されているものであって一体に運動するので、外間 2 と浮体 3 の間で上述の如く相対的な角変位運動が生ずると、 数変位に応じた電だけ受光素子 9 上のスリット 像は移

され、一方前記の浮体保持5のコ字形の上下腺の先端には互いに内向きに対向してピポット軸受13が設けられ、上記ピポット12の尖锐な先端がピポット軸受け13の凹部に嵌合することで浮体の保持がされる。

14は外筒の上蓋であり、シリコン接着剤等を用いた公知の技術により外筒2内に被体を封入すべくシール接着されている。

動する。 したがって受光した光の位置によって出力の変化する光電変換素子である該受光素子 B の出力は、 該スリット 像の位置変位に比例した出力となり、 該出力を情報として外筒 2 の角変位を検出することができる。

## 特閒平3-186702(6)

は逆に流せば逆方向に働くことは言うまでもないことである。 すなわち本実施例の構成に於ては磁力作用により评体を自在に正逆両方向に駆動することが可能である。

次に、本発明の制御を行なう全体回路につい て、第5回を用いて説明する。

第5図Aの回路部分は、外筒2に対して浮体

るので、OPアンブ45、フィードバック抵抗47、電流値検出用抵抗49、トランジスター50にて構成される定電液タイプのIREDドライバー回路は、Va+Vbの出力に応じて発光素子8への通電電流を可変させ、結果としてVa+Vbの出力がOPアンブ45の非反転入力端子に接続されている基準電圧KVCに等しくなるように、負

尚、コンデンサー48はこの帰還系が発掘しないようにする為の、位相補償用コンデンサーであり、抵抗47との組み合わせによって全体の普域を決定している。

以上の様に、本例では受光素子9で発生する 光電液を常に一定に保つようにしているので、 受光素子9の2つの出力の整信号VaーVbは、塩 度等の変化や素子のばらつき等の影響を受けず に、常に正しく外両2と浮体3の相対位置を検 出することができる。

次に第5図Bの回路の部分を説明すると、これはセンサーとしてのパラメーターを快定する

3が相対的に回転した位置を検出する上述の光学的な検出手段のための位置検出回路を示している。すなわち発光素子8から発せられた赤外光が浮体3で反射され、位置検出用の受光素子9でこれを受光して角変位を検出する基本構成である。

第 5 図 C の 回路部分を説明すると、これは実際に参館コイル 7 を襲動する為のドライバー回路部分をなしている。

すなわち、OPアンプ 5 1、トランジスタ 5 2、53、電流検出用抵抗 5 4 によってブッシュブルタイプの定電流回路が構成され、第 5 図の矢印で示した X . Y のいずれの方向に対しても電流を抜すことがでる。よって OPアンプ 5 1 の 弁反

転入力場子に印加されたCPアンプララの出力電圧に比例した電流が、参雄ロイル7に通電される。

以上のような回路構成によれば、外筒2と浮体3の相対位置信号 Va - Vbの数分値に比例した電流を巻線コイル7へ通電することによっては可述したように浮体3とヨークBで構成されるのが発生し、この力は当然巻線コイル7の電流で に比例することから、外筒2と浮体3の相対速度に比例した力を発生することになる。

次に、本発明のセンサーとしての特性を、第8回に示した周波数上の伝達特性を用いて説明する。入力としての角変位信号である I(S) は外筒 2の絶対空間に対する変位を示したものであり、又、本発明センサーによって検出される出力角変位 O(S) は、浮体 3の絶対空間に対する変位 R(S) と入力角変位 I(S) の相対関係から検出される為。

$$O(S) = I(S) - R(S) - (1)$$

3 内の液体の慣性モーメント J を使って、 純体 空間に対する 浮体の角変位 R (S) を 表現する と

$$R(S) = \frac{1}{JS^2} (K + \eta S + \eta uS) O(S) -- (2)$$
の式で表わされる。

(1).(2)式を使って、本発明の伝達特性を表わ すと

$$\frac{0(S)}{I(S)} = \frac{JS^2}{JS^2 + (\eta + \eta u)S + K}$$
 … (3)  
の式となる。

(3) 式は 2 次のハイバスフィルターの特性を示しており、 粘性力を電気的にコントロールすれば、 液体の粘度が温度によって変化した場合でも、 温度に応じてコイル通電のゲインを可変させてやれば、常に周波数特性を一定に保つことができる。

#### [実施例2]

第7図は本発明の第2の実施例を示すものであり、第7図のA及びCの回路部分は、第5図と全く同様であるため説明は省略する。

の式で扱わされる。

又、この出力角変位は外筒2と浮体3の相対 角変位であり、従来例で説明したように外節2 に封入された液体によって、外筒2と浮体3の 相対速度に比例した粘性力 n SO(S) が発生す る。一方、ヨーク6の巾が浮体3の移動方向に 対して無限大に広ければ、木来巻線コイル7へ の通電を行わない状態では磁力によるばね力は 発生しない筈であるが、実際にはヨークの巾が 有限であることから、従来例で説明した様に、 その力は微弱ながらばね力 KO(S) も働く。更に 本実施例では、前述した方法によって外簡2と 浮体 3 の相対変位の微分値に比例した電流を巻 ねコイル7に通電して力を発生させることによ り、新たな粘性力を加えることができる。ここ で、コイル通電による粘性力 n u S C (S) は元の粘 性力 n SO(S) と同一方向に働き、コイル通電の ゲインを可変させることにより任意の粘性力を 発生することが可能となる。

以上の力が、浮体3に働く力と考えると外筒

OPアンプ 6 1 の出力はドライバー回路部 C に 入力されており、第 1 の実施例で述べた様に、 ドライバー回路部 C では OPアンプ 6 1 の出力に 比例した電流を巻線コイル 7 へ通電することに なり、よって本実施例では外筒 2 と浮体 3 の相 対変位の微分値、即ち相対速度に比例した力を 発生する。

#### [実施例3].

第8図は本発明の第3の実施例を示すものであり、コイル通常による粘性力を温度に応じてデジタル的に可変させるようにした例を示している。第9図はそのフローチャートを示したものである。ここで、Aの検出回路部分、及びC

するシジスターリの値をりにりセットしてい る。次にフロー202 ではCPU71からの A/D 影御信号によって A/Dコンパーター7 O が外筒 2 と浮体 3 の相対変位出力 Va - Vb及び感温抵抗 による電圧レベルの A/D変換を開始する。次 に、フロー203 で A/D変換が終了したかどうか を判定し、 A/D変換が終了した場合には、フ ロー104 でまず変位センサーの A/Dの結果が CPUレジスターAに転送され、次にフロー 205 で温度データの出力がCPUレジスター B に転送される。フロー208 では、公知のS-2 変換に伴う時間輸上での微分演算が行われ、そ の結果がレジスターAにセットされる。一方、 フロー207 では温度データーが記憶されている レジスターBの値によって、メモリーデーター 110 から所定の値がレジスターとに転送される ことになり、温度データーに対応したゲイン データがセットされる。次にフロー208 では D/Aコンパーターへ転送する為のデータとし て、レジスターAの値とKの値を受算した値を のドライバー回路部分については、第 1 、第 2 の実版例と同様である。

次に、本実施例の動作を第9回のフローチャートを用いて説明する。

まず、フロー200 ではデジタル的に変位センサーの出力 Va - Vbを撤分する為の係数を登定しており、ここでTの値は A/B変換を行う為のサンブリング時間の周期を表し、Cは第5回のコンデンサー59の容量値、Rは抵抗60の抵抗値を表わしている。フロー201 では溶算に使用

レジスターA にセットし、フロー 208 でレジスター A の値を D/Aコンパーター 7 2 に転送する。次に、フロー 210 で C P U 7 1 からの制御信号 7 によって D/Aコンパーターが動作を開始し、フロー 211 で D/A変換が終了したことを検知した後、再びフロー 202 へ戻って上記動作を経り返す。

そして、D/A コンパーター72の出力は、ドライパー回路 C の入力部に接続されているので、D/Aコンパーターの出力に比例した電流が巻線コイル7へ通電される。従って、本実施側では温度に対するコイル通電のゲインを設定するデーターをあらかじめ記憶しておけば、液体の粘性が変化してもコイル温電による粘性力によって全体の周波数特性を一定にできる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、本発明の角変位検出藝電は、センサーに含まれる液体の粘性が温度によって大巾に変化した場合でも、温度に応じてコイル通電による粘性力を可変させることで、

## 转開平3-186702 (**9**)

常に特性を一定に保つことができるといった効果がある。

したがって粘性特性に高い温度依存性のある 液体を用いた場合にも、広い温度範囲に渡って 特度の高い角変位測定が可能であるという効果 がある。

また通常はコイルに過せの必要がなく、また 液体に対する磁力作用を及ぼすための通電電力 も小さくてよいなど、省エネルギーで小型の装 置を構成できるという効果もある。

#### 4. 図面の簡単な説明

δ.

第7回は本発明の実施例2の創御を行なうた めの創御回路の全体図である。

第8図は本発明の実施例3の創御を行なうための制御回路の全体型、第9図は同回路による制御助作を説明するフローチャートである。

第1 0 図~第1 2 図は従来例を説明するための図であり、第1 0 図は角度検出装置の平面概要図、第1 1 図は第1 0 図の維断面図、第1 2 図は邰品展開図である。

1:地板

2 - ALSS

3: 浮体

3 a : ₹ 5 --

3 b:軸 .

4 : 液

5: 禅体支持体

6;3-9

7:巻韓コイル

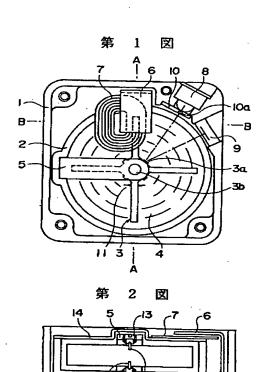
8:受光素子

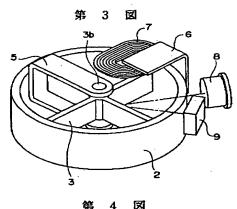
9: 受光素子

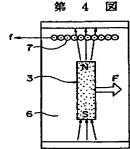
10:20=1

14:上蓋

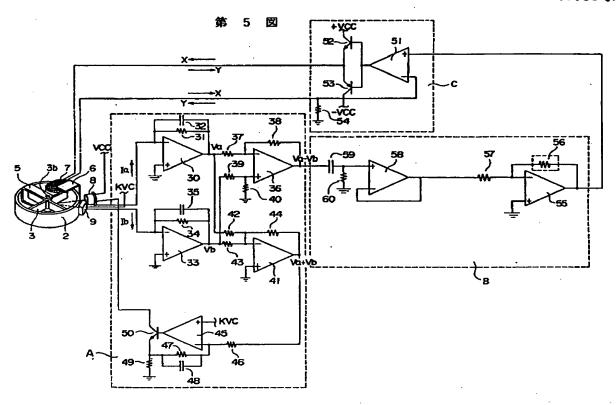
代理人 本 多 小 平 他 4 名

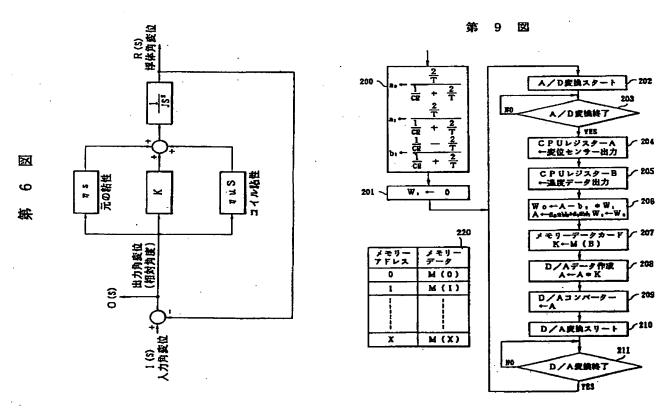




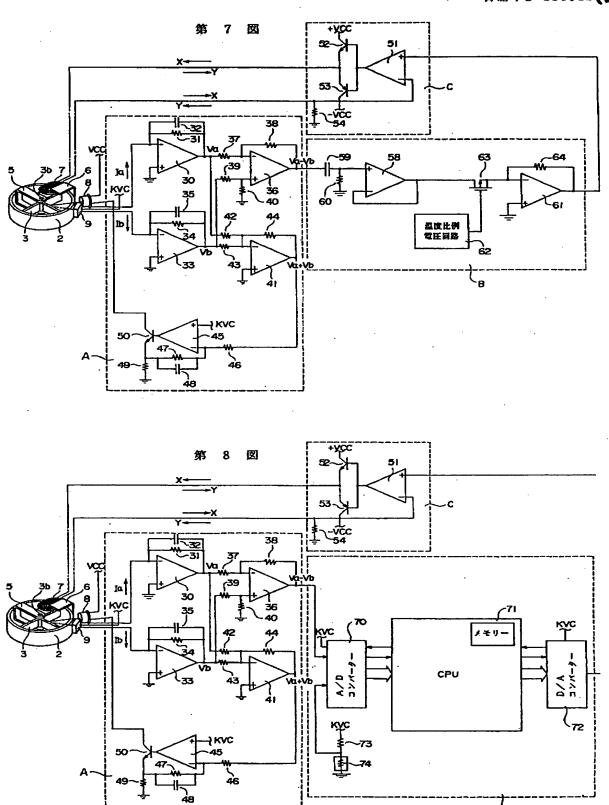


特閒平 3-186702 (10)

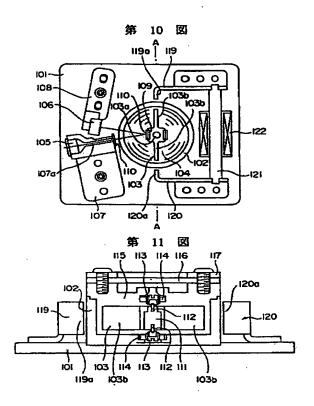


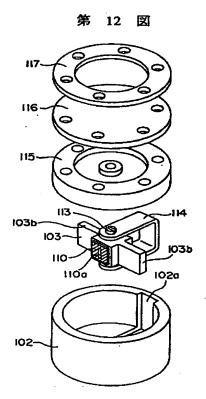


特蘭平3-186702(11)



# 特節平 3-186702 (12)





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.